

# 装置と場所の対応表 Equipment and Location Correspondence Table

## 共通機器センター Shared Research Facilities

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name			
1	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ Technoplaza	X線回折装置 XRD X-ray Diffractometer	Ultima IV (Rigaku)			
2				SmartLab (Rigaku)			
3		テクノプラザ	走査型電子顕微鏡 SEM Scanning Electron Microscope	汎用SEM 6010LV (JEOL)			
4		テクノプラザ5(01I32室)		新分析SEM with EDS (JEOL/JSM-IT510LV)			
5		テクノプラザ	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM Field Emission-type SEM	FE-SEM JSM-7610 (JEOL)			
6				FE-SEM JSM-7100 (JEOL)			
7		テクノプラザ2*	電子線マイクロアナライザ EPMA Electron Probe Micro Analyzer	EPMA-8050G(Shimazu)			
8		テクノプラザ		熱重量示差熱分析装置 TG-DTA Thermal Analysis	TG-DTA2020SA (BRUKER AXS)		
9				精密熱重量ガス分析装置 TG-MS Thermogravimetry Mass Spectrometer	TG5500 SI(ティ・エイ・インスツルメント) & GSD350(PFIFFER VACUUM)		
10				レーザー顕微鏡 Laser Microscope	OLS4000 (Olympus)-1		
11					OLS4000 (Olympus)-2		
12				デジタルマイクロスコープ Digital Microscope	VH-Z100UR (KEYENCE)		
13				プローブ顕微鏡 Probe Microscope	汎用AFM AFM5000 II (HITACHI)		
14				テクノプラザ2*		高機能AFM SPM8000-FM (Shimazu)	
15				テクノプラザ		光学顕微鏡 Optical Microscope	BX51(Olympus)
16						引張圧縮試験機 Mechanical Testing Machine	AG-50kNX (Shimazu)
17						ゼータ電位・ナノ粒子径測定システム Zeta-Potential and Nano-Particle-size Analyzer	DelsaMax PRO(BECKMAN COUTER)
18		テクノプラザ2*	顕微ラマン分光装置 Laser Raman spectrometry	LabRAM HR Evolution(HORIBA)			
19		分析解析センター3 12F30	分光エリプソメーター Spectroscopic Ellipsometer	RC2-DI-SUY(J.A.Woollam社 ジェー・エー・ウーラム・ジャパン)			
20		テクノプラザ		フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR Fourier Infrared Spectrometer	IRAffinity-1S(Shimazu)		
21				顕微フーリエ変換赤外分光光度計 FT-IR Fourier Infrared Spectrometer	FT-IR-4X + IRT-5200 (Jasco)		
22				紫外可視分光光度計 UV-Vis Spectrophotometer	V630-BIO (Jasco)		
23				テラヘルツ分光光度計 Terahertz Spectrophotometer	VIR-F (Jasco)		
24				紫外可視赤外分光光度計 UV-Vis-NIR Spectrophotometer	UV-3600 Plus(Shimazu)		
25				分析解析センター3 12F30	分光蛍光光度計 Spectrofluoro-Photometer	FP-750 (Jasco)	
26		テクノプラザ	X線CTスキャン X-ray CT Scan	μ Ray8700(Matsusada)			
27		テクノプラザ2*	スパッタリング装置 Sputtering Equipment	CFS-4ES II (SHIBAURA MECHATRONICS)			
28		テクノプラザ	サーマルマネキン Thermal mannequin	TM8-22R(PT-Teknik)			
29		分析解析センター3 12F30	自動接触角測定装置 Contact angle measuring device	OCA15EC (Dataphysics Instruments GmbH)			
30			窒素吸着比表面積細孔分布測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp II mini (MicrotracBEL Corp.)			
31		09I25 クリーンルーム	マスクレス露光装置 Maskless Lithography System	DL-1000GS/SS (NanoSystem, 9Fクリーンルーム)			
32		分析解析センター3 12F30	偏光ゼーマン原子吸光度計 Polarized Zeeman atomic absorption spectrophotometer	Z-2300 (HITACHI)			
33			質量分析計 Mass Spectrometer	AXIMA-CFR+(plus) (SHIMADZU)			
34		13G27-b	大気圧イオン化高分解能飛行時間型質量分析計 Mass Spectrometer	JMS-T100LP (JEOL)			
35		分析解析センター3 12F30	円二色性分散計 Circular dichroism spectrometer	J-820 (JASCO)			
36		分析解析センター2 11B27	核磁気共鳴装置 Nuclear Magnetic Resonance, NMR	JNM-ECZL400R (JEOL)			
37		テクノプラザ5(01I32室)	真空加熱蒸着装置 Vacuum Evaporation System	SVC-700T (SANYU ELECTRON)			
38		テクノプラザ2*		電子ビーム蒸着装置 Electron Beam Evaporation System	SVC-700LEB (SANYU ELECTRON)		
39				シリコン深掘り装置 (Deep RIE) Silicon Deep Reactive Ion Etching Machine	MUC21 ASE-SRE (SPP technologies)		
40				2次元印刷装置 (フードプリンター) Food Printer	MMP-F13S (Mastermind)		
41				プラズマ微細加工装置 Plasma microfabrication equipment	TEP-01x (立山マシン株式会社)		
42				その他MEMS関連装置群 (スピンドクター、ホットプレート、乾燥器等 Spin Coater etc. for MEMS)	-		
43		テクノプラザ5(01I32室)	小型無冷媒型 PPMS	VersaLab TM (Quantum Design)			
44		分析解析センター3 12F30	半導体パラメータアナライザ	4156B (Hewlett packard)			
45		テクノプラザ2*	手動回転研磨機 Rotary Polishing Machine	LaboPol-30 (Struers)			

46	テクノプラザ	アクティブラーニングスペース Active Learning Space	打ち合わせスペース Meeting space	
47		テクノ工房 Techno Studio		
48		低速切断機アイソメット Low speed cutting machine	Isomet (Buehler)	
49		恒温振とう培養器 Homeothermic shaking incubator	BR-11FP (タイテック)	
50		小型電気炉 Small electric furnace	HPM-1N (As one)	
51		小型熱プレス機 Small heat press machine	AH-2003 (As one)	
52		テクノプラザ4	レーザー加工機 大型 (A1サイズまで) Laser cutting machine	Speedy400 (Trotec Laser) 100W
53			レーザー加工機 小型 (A3サイズまで) Laser cutting machine	Rayjet 50 (Trotec Laser)
54			樹脂用簡易CNC切削機	MODELA model MDX-40 (ローランド ディージー)
55			熱溶融積層型3Dプリンタ Fused Deposition Modeling 3D Printer	Ender 3 S1 Pro (Creality)
56			101-2	電界放出型走査電子顕微鏡 FE-SEM(Field Emission-type SEM)
57	202	透過型電子顕微鏡TEM TEM(Transmission Electron Microscope)	JEM-2100(JEOL)	
58		(新)集束イオンビーム加工装置 FIB(Focused Ion Beam)	MI-4050(日立ハイテック)	
59		(旧)集束イオンビーム加工装置 FIB(Focused Ion Beam)	FB-2000A(日立ハイテクノロジ)	
60		X線回折装置 XRD(X-ray Diffractometer)	SmartLab (Rigaku) Rintの置き換えです	
61		単結晶X線構造解析装置 Single-Crystal Xray Diffraction	D8 QUEST(ブルカージャパン)	
62		レーザー顕微鏡 Laser Microscope	OLS-1100(オリンパス)	
63		窒素水蒸気吸着比表面積測定装置 Adsorption Measurement	Belsorp MaxII (MicrotracBEL Corp.)	
64		真空蒸着装置 Vacuum Evaporation System	JEE-400(JEOL)	
65		ウルトラミクロトーム Ultra microtome	EM-ULTRACUT UCT(ライカ)	
66		精密研磨装置 Polisher	ダイヤラップML-150P(マルトー)	
67	マニュアルプローバー Manual prober	705B(日本マイクロニクス)		
68	ピコ秒蛍光寿命測定装置	C11200(浜松ホトニクス)		
69	絶対PL量子収率測定装置	C9920-02G(浜松ホトニクス)		
70	101-1	超純水製造装置 Ultrapure water production equipment	Direct-Q UV(ミリポア)	
71		光学顕微鏡 Optical microscope	LV100D-U(ニコン)	
72		ナノインプリント装置 Nanoimprint equipment	LTNIP-5000(リソテック)	
73		超臨界乾燥装置 Supercritical dryer	SCRD4(レクザム)	
74		熱処理装置 Heat treatment equipment	GFA430VN(サーモ理工)	
75		無電解メッキ装置 Electroless metal plating equipment	* (山本鍍金試験器)	
76		スピンドーター Spin coater	ACT-300A II (アクティブ)	
77		膜厚計測装置 Film thickness measuring device	FE-300(大塚電子)	
78		超音波ホモジナイザー Ultrasonic homogenizer	UP-50H(ヒールツシャー)	
79		104	プロトンビームライター PBW(Proton Beam Writer)	MBS-1000(神戸製鋼所)
80	105	超伝導量子干渉磁束計 SQUID Superconducting quantum interference device	MPMS-XL(日本カンタムデザイン)	
81	107	核磁気共鳴装置 NMR(Nuclear Magnetic Resonance)	JNM-ECZL400R(JEOL)	
82	301	LC-MS(高速液体クロマトグラフィー-QTRAP 型質量分析装置) Liquid chromatography mass spectrometer	QTRAP® 5500 LC-MS/MS(AB Sciex Pte. Ltd.)	
83	301	セルソーター(フローサイトメーター) Cell Sorter	BD FACSAria III(日本ベクトン・ディッキンソン)	
84	303	放電プラズマ焼結(SPS)装置 Spark plasma sintering equipment	LABOX-210(シンターランド)	

\*テクノプラザ2とは、交流棟1階 テクノプラザ3室隣の部屋です。  
Technoplaza 2 is located next to Technoplaza3 on the first floor of Kouryu-bulding.

### ものづくりセンター Manufacturing Center

番号 Number	場所 Place	居室 Room	一般名 Common name	装置名 Equipment name
85			立形マシニングセンタ Vertical Machining Center	MB-46VA(オークマ)
86			射出成形機 Injection Molding Machine	NPX7-1F(日精樹脂工業株)
87			バンドソー、コンターマシン Contour machine	NCC-300LE(ニコテック)
88			ファインカッター高速切断機 High-speed cutting machine	HS45A型Cタイプ(平和テクニカ)

89	豊洲校舎 Toyosu campus	テクノプラザ3	CNCワイヤー放電加工機 CNC wire electric discharge machine	VL400Q(ソディック)
90			卓上フライス盤 Bench type milling machine	YS300MT(東和精機)
91			卓上旋盤 Bench lathe	YS550V(東和精機)
92			積層造形機 Additive manufacturing machine	M3DS-100(ファソテック)
93			油圧プレス(5t) Hydraulic press	HYP-505H(JAM)
94			ビッカース硬さ試験機 Hardness testing machine	アカシ(ミットヨ)
95			オートグラフ Universal testing machine	AG-20kNG(島津製作所)
96			ベンチグラインダー Bench grinder	FG255T(YODOGAWA)
97			圧入機 Press fitting machine	渡辺機械
98			バンドソー Band Saw	K-100(ホーザン)
99			ボール盤 Drilling machine	TB131(マキタ) DP3050R(REXON)
100	大宮校舎 Omiya campus	4号館4102室	マシニングセンタ	V33i(MAKINO)
101			ターニングセンタ	LB3000EX II(okuma)
102			芝ミル(樹脂&低負荷金属用卓上CNCフライス)	向島テック
103			フライス盤	AM103(DMG MORI)
104			フライス盤	NK-1R(IWASHITA)
105			旋盤	MATE-570S(ヤマザキマザック)
106			帯鋸盤	CRA-300(AMADA)
107			コンタマシン	U-500(LUXO)
108		ボール盤	ESD-460(遠州工業)	
109		4号館4101室	卓上旋盤	L5200型S(コスモキカイ)
110			卓上フライス盤	FK-500S(コスモキカイ)
111	卓上ボール盤		大西機械設計	
112	バンドソー		BS23(東洋アソシエイツ)	
113	ベルトグラインダー		BGM-50(日立工機)	